



EV Group schließt Bau von hochmodernem Reinraumgebäude am Hauptsitz ab

Das neueröffnete Cleanroom V – Gebäude verdoppelt nahezu die verfügbare Reinraumfläche und erweitert die Möglichkeiten der NILPhotonics® und Heterogeneous Integration Competence Center™

ST. FLORIAN, Österreich, 20. Juli 2020 — EV Group (EVG), ein führender Entwickler und Hersteller von Anlagen für Waferbonding- und Lithographieanwendungen in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie, gab heute die Fertigstellung des neuen, „Cleanroom V“ genannten Reinraumgebäudes am Firmensitz in Österreich bekannt. Mit dem Neubau auf dem aktuellsten Stand der Entwicklung und Technologie im Reinraumbau wird die verfügbare Reinraumkapazität zur Produkt- und Prozessentwicklung, Anlagendemonstration, Musterentwicklung und für Pilotserien-Produktionsservices am EVG Headquarter nahezu verdoppelt. Als Teil eines [im letzten Jahr angekündigten](#) 30-Millionen-Euro-Investments wird das „Cleanroom V“-Gebäude offiziell im August eröffnet.

Das neue Reinraum V-Gebäude ist direkt mit den bestehenden Reinraum- und Anwendungslabors von EVG verbunden und bietet rund 620 Quadratmeter zusätzliche Reinraumfläche der Reinheitsklasse 10. Das neue Gebäude beherbergt darüber hinaus auch ein modernes Schulungs- und Trainingszentrum mit mehreren speziell ausgestatteten Bereichen für die Schulung von Kunden und Service-Ingenieuren auf den Equipment-Plattformen von EVG. Im Rahmen der Investition in die Erweiterung wurde auch die bestehende Infrastruktur der Reinräume und Anwendungslabors aufgerüstet, einschließlich der Schaffung redundanter Systeme zur Sicherstellung höchster Verfügbarkeit und aktuellster Sicherheitsstandards.

Ausbau von EVGs Kompetenzzentren für Technologie-Exzellenz

Die zusätzlichen Kapazitäten, die durch das neue Reinraum V-Gebäude entstehen, erweitern die Möglichkeiten der beiden Kompetenzzentren, EVGs „NILPhotonics®“ und „Heterogeneous Integration Competence Center™“, welche [Dienstleistungen zur Prozessentwicklung auf höchstem Niveau](#) bereitstellen und als bewährte Open-Access-Innovationsinkubatoren für die Kunden und Partner in der gesamten Mikroelektronik-Lieferkette dienen. Mit diesen Technologie-Kompetenzzentren unterstützt EVG seine Kunden bei der Beschleunigung der Technologieentwicklung, der Risikominimierung und der Entwicklung bahnbrechender Technologien und Produkten durch den Einsatz von Nanoimprint-Lithographieverfahren bzw. der heterogenen Integration, während gleichzeitig höchste IP-Schutzstandards für die Arbeit an Prototypen und Vorserienprodukten garantiert werden.

"Wir sind sehr stolz auf die technischen Innovationen und das Know-how, die in den Bau dieses neuen Reinraums eingeflossen sind. Die Einrichtung auf weltweit höchstem Niveau entspricht bis ins kleinste Detail dem neuesten Stand der Technik und befindet sich zweifellos auf Augenhöhe mit den technisch fortschrittlichsten Reinräumen in Europa", erklärte Markus Wimplinger, Corporate Technology Development & IP Director von EV Group. "Für EVG wird dieses neue Gebäude unsere Fähigkeiten, gemeinsam mit unseren Kunden künftige Anwendungen und Technologien zu entwickeln, weiter verbessern. Insbesondere bieten sich auch optimale Rahmenbedingungen für unsere beiden stark nachgefragten und ausgelasteten Kompetenzzentren. Die einzigartigen Dienstleistungen, die in unseren Kompetenzzentren für NILPhotonics und heterogene Integration angeboten werden, ermöglichen es unseren Kunden und Partnern, die Entwicklungszyklen zu verkürzen und neuartige Produkte in diesen entscheidenden und zukunftsweisenden Anwendungsbereichen zu erschaffen."



EV Group schließt Bau von hochmodernem Reinraumgebäude am Hauptsitz ab **Seite 2 von 2**

Dank der Technologie-Kompetenzzentren und starker Partnerschaften mit seinen Kunden ist EVG in der einzigartigen Position, den Auftraggebern lückenlose Prozessentwicklungs-Dienstleistungen und -Unterstützung anzubieten. Gleichzeitig tragen die lokalen Installations- und Supportteams von EVG sowie die Möglichkeit der Unterstützung aus der Ferne dazu bei, die Installation und Wartung der EVG-Anlagen jederzeit durchgehend sicherzustellen. Nähere Informationen zu EVGs Dienstleistungen finden Sie auf <https://www.evgroup.com/services/>.

Weiterführende Informationen zu EVGs NILPhotonics Competence Center und Heterogeneous Integration Competence Center finden Sie unter <https://www.evgroup.com/products/process-services/>.

EVG präsentiert die vollständige Produktpalette an Waferbondern, Lithographie- und Photoresist-Verarbeitungslösungen auf der Messe SEMICON West, welche dieses Jahr virtuell vom 20. bis 23. Juli stattfindet. Messebesucher, die weitere Informationen über Produkte und Dienstleistungen suchen, sind eingeladen, auf unserem virtuellen Messestand mit einem Ansprechpartner von EVG in Kontakt zu treten bzw. die neuesten Informationen herunterzuladen.

Über EV Group (EVG)

Die EV Group (EVG) ist anerkannter Technologie- und Marktführer für Präzisionsanlagen und Prozesslösungen zur Waferbearbeitung in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie. Zu den Kernprodukten gehören Waferbonder, Systeme zur Dünnwafer-Bearbeitung, Lithographie- und Nanoprägelithographie-Systeme sowie Fotoresist-Belacker, Reinigungs- und Metrologiesysteme. Das 1980 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in St. Florian am Inn (Austria) beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter und betreut mit eigenen Niederlassungen in USA, Japan, Korea, China und Taiwan sowie Repräsentanzen namhafte Produktionskunden und R&D-Partner in aller Welt. Für mehr Informationen siehe www.EVGroup.com.

Kontakte:

Clemens Schütte
Director, Marketing and Communications
EV Group
Tel: +43 7712 5311 0
E-Mail: Marketing@EVGroup.com

David Moreno
Principal
Open Sky Communications
Tel: +1.415.519.3915
E-Mail: dmoreno@openskypr.com

###